



ZEISS O-INSPECT duo

Pierwszy system multi technologiczny ZEISS:
mikroskop i współrzędnościowa maszyna pomiarowa



Seeing beyond

ZEISS O-INSPECT duo

Metrologia i mikroskopia w duecie

ZEISS O-INSPECT duo łączy dwie technologie w jednym produkcie i zapewnia narzędzie zarówno dla mikroskopii, jak i metrologii zarówno optycznej jak i stykowej.

Połączenie systemu ZEISS ZEN core i oprogramowania metrologicznego ZEISS CALYPSO w jednej maszynie multisensorowej dostarcza wyjątkowych korzyści i pomaga zautomatyzować procesy, usprawnić konfigurację systemu i dokumentację wyników.

Rozwiązanie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, wszędzie tam, gdzie części są płaskie i wymagają pomiaru stykowo-optycznego lub gdy potrzebny jest jednocześnie pomiar i inspekcja powierzchni.



Przykłady zastosowania

Motoryzacja

- folia akumulatorowa
- stosy ogniw paliwowych
- piny silnika elektrycznego

Przemysł elektroniczny

- płytki drukowane
- wyświetlacze
- łączenia
- piny

Komponenty medyczne

- implanty stawu kolanowego
- śruby ortopedyczne
- implanty dentystyczne

Informacje techniczne

Specyfikacja	ZEISS O-INSPECT duo
Rozmiar/zakres pomiarowy w mm	800×600×300
Obiektyw	ZEISS Discovery.V12 scout 160 c kamera kolorowa 5 MP, 2464×2056 pikseli
Oświetlenie	16 segmentów w pierścieniu LED światła białego, koncentryczne światło przechodzące i odbite
Dystans roboczy w mm	55
Zoom optyczny	12×
Pole widzenia w mm	10,48 x 8,6 (max.)
Głowica stykowa	ZEISS VAST XXT – TL1/TL3
Dokładność pomiaru	1D: 1,5 μm + L/250 2D: 1,8 μm + L/250 μm 3D: 2,2 μm + L/250 μm
Oprogramowanie	ZEISS CALYPSO (przy zastosowaniach metrologicznych) ZEISS ZEN core (przy zastosowaniach mikroskopowych)
Nośność stołu	do 100 kg



Najważniejsze cechy i zalety

1 System typu 2-w-1

ZEISS O-INSPECT duo to system do wielu zastosowań, który łączy w sobie funkcjonalności dwu urządzeń: współrzędnościowej multisensorowej maszyny pomiarowej i mikroskopu.

2 Duże pole widzenia i obszar pomiarowy

Ze względu na swoje wymiary (zakres pomiarowy 800 × 600 × 300 mm) ZEISS O-INSPECT duo to rozwiązanie do inspekcji dużych części lub pomiarów równoległych wielu małych części.

3 Dwa systemy operacyjne

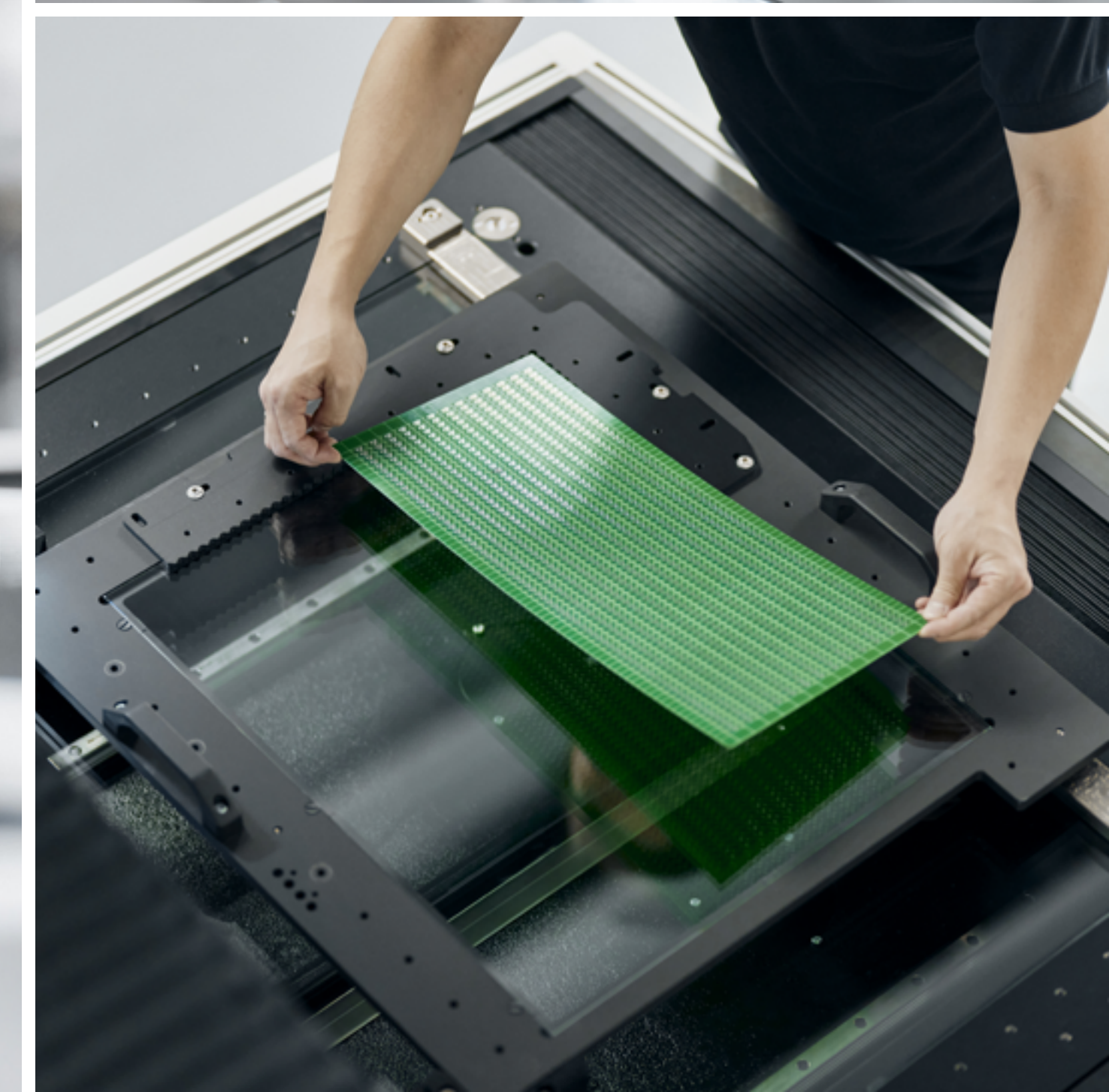
Urządzenie posiada dwa specjalistyczne systemy - każdy do innego zadania: ZEISS CALYPSO do metrologii i ZEISS ZEN core do mikroskopii.

4 Zoptymalizowane procesy

Wykonując zadania pomiarowe i inspekcje na tym samym urządzeniu możesz skrócić czas konfiguracji, ograniczyć koszty utrzymania urządzeń i uzyskać więcej przestrzeni w laboratorium.

5 Wyjątkowa jakość obrazowania

Kolorowa kamera o rozdzielczości 5MP z optyką ZEISS scout 160 oferuje wysoką rozdzielczość przy wielu poziomach powiększenia, co pozwala uchwycić nawet najdrobniejsze szczegóły.



Najważniejsze cechy i zalety

6 Zautomatyzowane procesy

W pełni zautomatyzowane pomiary i inspekcja, obrazowanie i kompletaacja dokumentacji dużych części lub pomiarów seryjnych przy zachowaniu dużej przepustowości.

7 Elastyczne podejście do pomiarów dzięki wymianie głowic

ZEISS O-INSPECT duo to maszyna multisensorowa co oznacza, że ma możliwość wymiany głowicy optycznej na stykową ZEISS VAST XXT, która umożliwia skanowanie z wysoką dokładnością.

8 Wysoka dokładność

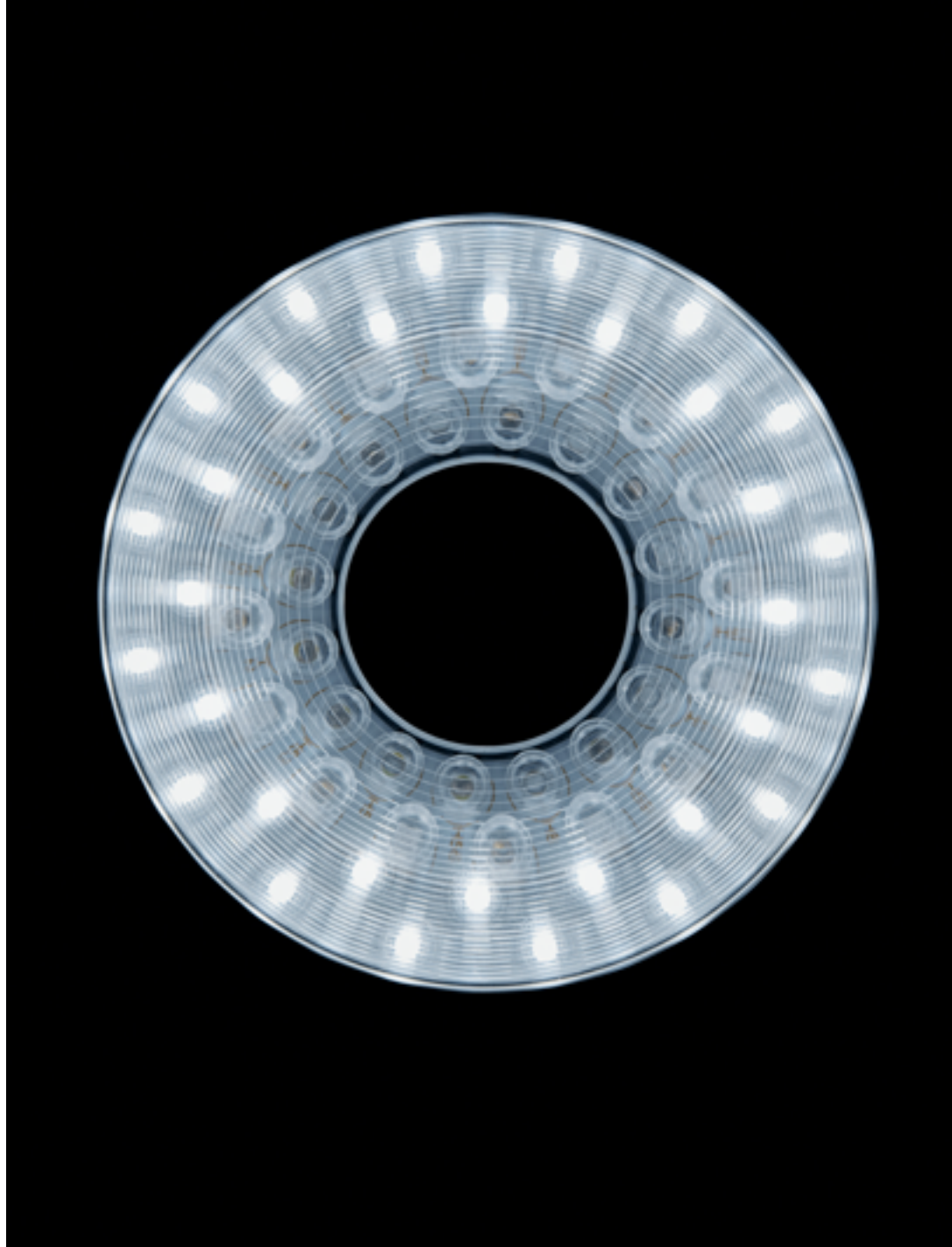
ZEISS O-INSPECT duo, zgodny z MPE E0 (3D) normy ISO-10360, zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów i zapewnia porównywalność z dokładnością od $1,5 \mu\text{m} + L/250 \mu\text{m}$.

9 Efektywność cenowa

Dzięki rozwiązaniu 2-w-1 maszyna ZEISS O-INSPECT duo to trwałe i ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ koszty zakupu systemu i późniejszego serwisu są niższe w porównaniu do dwóch maszyn.

10 16-segmentowe oświetlenie LED

16-segmentowe pierścieniowe oświetlenie LED ze światłem białym, współosiowym oświetleniem w górę i podświetleniem do różnych zadań pomiarowych i obrazów o wysokim kontraście.



Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami po więcej informacji
lub aby umówić prezentację systemu

[Formularz kontaktowy](#)





Seeing beyond